#### 研究成果報告書 科学研究費助成事業



今和 5 年 5 月 2 9 日現在

機関番号: 13601
研究種目: 基盤研究(C)(一般)
研究期間: 2019 ~ 2022
課題番号: 19K03743
研究課題名(和文)強磁性状態の電気伝導をプローブとしたルテニウム酸化物の低温下水素吸着・吸蔵の研究
研究課題名(央文)Investigation of hydrogen adsorption effect on ruthenium oxide interface using interface-sensitive resistance measurements
神原 浩(Kambara, Hiroshi)
信州大学・学術研究院教育学系・准教授
研究者番号:00313198
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,400,000円

研究成果の概要(和文):本研究では,金属ルテニウム酸化物の焼結体試料を用いて,酸化物が室温付近・還元 剤雰囲気下で受ける影響について電気伝導をプローブとして調べてきた。バルク敏感(4端子法)と界面敏感 (3端子法および点接触法)の測定方法を適用することで,試料内部と界面を分離して電気抵抗の時間変化を測 定した。その結果,室温という低い温度でも,表面/界面では,還元剤雰囲気(水素または一酸化炭素)下で界 面抵抗が上昇し,酸素欠損(還元)が起きていること,逆に,界面抵抗上昇後,酸素雰囲気下では酸素充填(酸 化)の過程が起きていることを明らかにした。反応速度論を応用した解析から,界面での反応速度定数と活性化 エネルギーを評価した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 水素雰囲気下でも室温では温度が低いため通常,酸化物は還元されないが,本研究では界面で徐々に反応が進行 していることを電気抵抗測定により明らかにした。本研究では金属ルテニウム酸化物に対して,バルク(試料内 部)敏感と界面敏感の手法でそれぞれの電気抵抗測定から,バルクと界面の応答を分離・抽出することが可能で あることを示した。室温・水素雰囲気下では,試料内部は影響を受けないが,界面抵抗は連続的に上昇し,逆に 酸素雰囲気下では界面抵抗は元の値へ減少していく。界面での酸素欠損の時間変化を反応速度論の応用で解析で きることを示しただけでなく,界面敏感プローブが化学反応の分析ツールとして有用であることも示した。

研究成果の概要(英文):In this study, I have investigated the influence of ruthenium oxides (SrRu03) on the electrical conductivity under reducing gas atmospheres near room temperature. By applying bulk-sensitive (four-terminal) and surface/interface-sensitive (three-terminal and point contact) methods, I have measured the time dependence of electrical resistance of the bulk (SrRu03) and the interface (SrRu03-Ag epoxy) separately. Even at low temperatures (such as room temperature), an increase in interface resistance was observed under reducing gas (H2 or CO) atmospheres, indicating oxygen deficiency (reduction) occurring gradually. On the other hand, a decrease in interface resistance due to oxygen replenishment (oxidation) was observed after oxygen substitution. Applying reaction kinetics, I evaluated the reaction rate constants and activation energies at the interface.

研究分野:物性物理学

キーワード: ルテニウム酸化物 水素吸着 界面敏感プローブ 界面電気抵抗 酸化還元反応

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

様 式 C-19、F-19-1、Z-19(共通)

#### 1.研究開始当初の背景

研究開始以前に,申請者は,金属ルテニウム酸化物 SrRuO<sub>3</sub>(160 K 以下で強磁性状態となる 擬ペロブスカイト酸化物,以下 SRO と省略)の界面状態に着目し,破断接合における局所的な 電気伝導特性の研究を行っていた。破断接合は外的な擾乱(振動や温度変化)により,接合状態 が変化してしまう問題があったが,外的擾乱に強い界面敏感測定手法の3端子法を適用し,電気 抵抗を調べていく過程で,室温下で SRO を水素雰囲気に曝すと,SRO の界面電気抵抗が顕著に 増大することを見出した。SRO は大気中では安定した物質であるが,200 程度以上の高温,5% 程度の水素混合ガス下での焼鈍では水素の SRO 内部への拡散や還元によって SRO が分解し, 抵抗が増大することが知られていた [Halley *et al.*, Mat. Sci. and Eng. (2004). など]。しかし,室温 程度の低い温度での水素雰囲気下での抵抗変化についてはよく知られていなかった。そこで,室 温付近での水素雰囲気下での SRO 界面電気抵抗の時間変化について調べることとした。研究開 始当初は水素吸着や吸蔵によって SRO の電子状態に変化が生じると,それに伴い転移温度以下 での強磁性状態にも変化が生じるのではないかという推測を持っていたが,この後に述べるよ うにバルク内部には水素は影響を与えず,界面付近でも水素曝露前後で強磁性転移に伴う抵抗 変化に大きな変化が現れなかったため,強磁性状態そのものではなく室温付近における電気抵

#### 2.研究の目的

金属ルテニウム酸化物 SrRuO<sub>3</sub>(SRO)が,還元剤(水素,一酸化炭素)雰囲気下で受ける影響 について,バルク(試料内部)の還元温度より十分低い室温付近で起きている現象について電気 抵抗をプローブとして調べる。電気抵抗は,バルク敏感な4端子法と,試料と電極間の界面に敏 感な3端子法を適用して,試料内部と界面を分離して,特に還元剤雰囲気下での時間応答に着目 し,界面状態の動的な変化を調べる。温度を変えた測定を行い,活性化エネルギーについての評

価も行う。その他,点接触法を適 用し,試料との界面を構成する電 極の材質を変えて異なる界面状態 での測定も行い,SROの界面状態 を実験的に明らかにする。

3.研究の方法

SROの焼結体試料を用い,4端 子法(バルク敏感)と3端子法(界 面敏感)の手法(図1)によって, バルクと界面を分離して電気抵抗 を測定する。SRO と界面を構成す る3端子法の電極としては,銀工 ポキシを主に使用し,材質依存性 を確かめるために銅エポキシも一 部用いた。まず,水素に曝露する 前と後の試料について,室温から 4 K までの温度変化で電気抵抗を 測定し,試料を評価する。その際, 参照物質として水素吸蔵金属のパ ラジウムを同手法で測定し,バル クと界面が分離して検出されてい ることを確かめる。水素応答の時 間変化を調べる際は,室温付近で 温度を固定して,参照物質として パラジウムの他,水素を吸蔵しな い銅,焼結体の炭素を比較する。 水素応答の温度変化は,10~60 付近までで温度を制御固定して測 定する。水素の他,還元剤として, ー酸化炭素を使用した同実験も行 う。また,還元剤雰囲気下での電 気抵抗が上昇した後,酸素雰囲気 下に置換し,逆の過程(すなわち 酸化)で電気抵抗の時間変化(電 気抵抗の減少の様子)を調べる。 これらの時間変化の測定データを





## 図 2 水素曝露前後における抵抗の温度変化 (a) Pd 4T, (b) SR0 4T, (c) Pd 3T, (d) SR0 3T.

反応速度論により解析する。

点接触法では,界面を構成する対向電極となる細線の材質を,金,白金,銀,銅,鉄に変えて材 質依存性について調べ,水素応答の時間変化を分析する。

4.研究成果

図2に,室温で水素に曝露する前と後のパラジウム(Pd)とSROの抵抗の温度変化の結果について示す。4端子法(4T)では,水素曝露したものは,Pdの抵抗は上昇し,50Kに緩やかな ピーク異常が観測されている。50K異常はバルクPdH合金でよく知られたものであり,Pd格子 内に水素が溶け込んでいる証拠となる。一方,3端子法(3T)では,水素曝露前よりも後の方が 抵抗は大きくなるが,50K異常はみられていない。抵抗値そのものも3T抵抗はバルクの約100 倍程度と大きく,3T抵抗はバルクではなく,界面抵抗を測定しているものと言える。SROのデ ータを見ると,バルク抵抗は水素曝露前後で変化しないが,界面抵抗は,水素曝露後でほぼ定数

倍,水素曝露前よりも大きくなって いる。つまり, SRO の内部は室温で の水素曝露では影響を受けないが, 界面は影響を受けて抵抗が増大して いることが分かる。室温での水素応 答の時間変化を,参照物質とともに 示したものが図3である。Pd は水素 導入直後からバルク抵抗は増大を始 め、ある程度時間がたった後、遅れて 界面抵抗が上昇している。一方,SRO は,水素導入後もバルク抵抗は全く 変化しないが,界面抵抗は連続的に 上昇していることが分かる。なお,参 照物質の銅、炭素に関しては、水素雰 囲気下で影響はほぼないものと見て よい。従って, SROは, 室温・水素雰 囲気下ではバルク内部までは影響は 及ばないものの,界面抵抗は時間と ともに上昇を続けていくことが分か った。

SRO の界面抵抗の水素応答時間変 化を ,温度を制御して固定し ,詳細に 調べた。また,水素の他に,同じく還 元剤として作用する一酸化炭素曝露 の実験も行った(図4)。もし,室温 下で SRO 界面が還元剤によって還元 されている(酸素欠損している)ので あれば,水素もしくは一酸化炭素を 排気した後 , 酸素に置換すれば逆の 過程(すなわち酸化による酸素充填) が起きると予想され,酸素置換後の 界面抵抗の時間変化も詳細に調べた (図4)。また,水素に関しては,水 素圧力依存性も調べた。以上の実験 結果を反応速度論により解析を行 い,次のことが分かった。

(i) 還元剤雰囲気下では界面抵抗変化は,水素雰囲気下の方が一酸化炭素雰囲気下に比べて10~60倍程度大きい。水素と一酸化炭素の界面への衝突因子の違いがその要因の一つである。

(ii) 還元剤雰囲気下での界面抵抗上 昇は、1次反応により界面での酸素 欠損が徐々に進行するモデルでよく 説明でき、1成分の速度定数による 指数関数でよく記述できる(図5 (a),(d))。

(iii) 水素雰囲気下では,(ii)に加え, 時間に比例して抵抗が上昇する項が



図3 室温·水素曝露における規格化抵抗の時間変化 (a) Pd,(b) SRO,(c) Cu,(d) C.



図 4 規格化した SRO-Ag 界面抵抗の時間変化の温度 依存性.(a)-(d) CO 曝露後,02 置換,(e)-(i) H2曝 露後,02 置換.

加わる(図5(a))(一酸化炭素雰囲気下では加わらない)。その起源としては水素による還元で 生じた水成分との反応によるものが考えられる。

(iv)界面抵抗上昇後に酸素雰囲気下に置換した後は,界面抵抗は元の値に近づくように減少する。その速度定数は,抵抗上昇の度合い(酸素欠損度合い)に応じて多成分が出現する。すなわち,水素雰囲気下により界面抵抗が大きく上昇した後は,45 以下の範囲で少なくとも3成分の速度定数が現れる(図5(b),(f))のに対して,一酸化炭素雰囲気下では27 以下では1成分(図5(e)),27~45 の範囲では2成分の速度定数で記述できる。これは,酸素充填の過程では界面より深いところへは速く充填され,界面に近づくにつれて充填はゆっくりと進行することを示していると考えられる。

(v) 上記(iv)の過程の温度変化からアレニウスプロットを作成し,速度定数の温度変化から活性 化エネルギーを見積もると,速度定数の最も大きな成分と2番目に大きな成分,2番目に大きな 成分と3番目の(すなわち最も小さな)速度成分の活性化エネルギーの比は1.2~1.3となってお り,界面より深い位置ほど活性化エネルギーが大きく,速度定数が大きいと考えられることと矛 盾しないことが分かった。

値しないことが方からた。 (vi) また,水素圧力を 25~100 kPaまで変化させた 場合,圧力に比例して前係 数が変化するが,同じ温度 では速度定数は変化しな いことを確認した。

以上の3端子法による 界面抵抗の時間変化の解 析から 室温下でも SRO 界 面が還元剤雰囲気下で 徐々に抵抗が上昇してお り,その原因は酸素欠損に よるものであることを明 らかにした。室温は試料内 部が還元される温度より は十分低温であるため,非 常にゆっくり還元が進行 しているものと考えられ る。界面敏感な電気伝導を プローブとし,化学変化の 詳細を追跡することがで きたと言える。

また,点接触法により界 面対向電極の材質を変え た実験も行った。点接触法 は細線を SRO 表面にゆる やかに接触させることで, 界面抵抗の材質依存性を 考察できる。その結果,金・ 白金,銀,銅,鉄の順で水



図5 (a),(b)SRO-Ag 界面での反応速度定数の温度依存性(アレ ニウスプロット).(a) H<sub>2</sub>曝露の還元過程では1成分() が現れる(は時間に比例する項の係数).(b) H<sub>2</sub>曝露後,0<sub>2</sub> 置換による酸化過程では3成分が現れる.(d)H<sub>2</sub>による還元 の模式図.(e) 0<sub>2</sub>による酸化過程の模式図(CO 0<sub>2</sub>の過程で 温度が低い場合,速度定数は1成分).(f) 0<sub>2</sub>による酸化過 程の模式図(H<sub>2</sub> 0<sub>2</sub>の過程では速度定数は3成分).

素雰囲気下での界面抵抗の上昇が遅くなっていく ことが分かった(図6)。水素が酸素欠損を誘起する ものと考えると,鉄電極が最も酸素欠損を起こしに くくさせるものと考えることができる。金属酸化物 の還元剤雰囲気下での安定性をエネルギー的に表 したエリンガム図を参照すると,銀,銅,鉄に関し ては,銀が最も不安定で,鉄が最も安定であること が分かる。すなわち,電極界面での酸素欠損の進行 度合いは,SROとの点接触により形成された疑似的 な酸化物界面の安定性と関係していることが示唆 される。界面抵抗変化の材質依存性は,SRO-電極界 面においては室温でも還元が進行していることを 裏付けるものと考えることができる。



図 6 点接触法による SRO 界面抵抗の 材質依存性

#### 5.主な発表論文等

## 〔雑誌論文〕 計2件(うち査読付論文 2件/うち国際共著 0件/うちオープンアクセス 2件)

1.著者名 Kambara Hiroshi, Tanaka Hiroyuki, Oishi Satoru, Tenya Kenichi, Tsujii Hiroyuki	4 . 巻 128
2.論文標題	5 . 発行年
Room-temperature reduction at SrRu03-metal interface in hydrogenous atmosphere detected by	2020年
interface-sensitive resistance measurement	
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Journal of Applied Physics	175306-1 - 9
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1063/5.0022041	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	-

1.著者名	4.巻
Kambara Hiroshi, Shimazaki Hiroshi, Tenya Kenichi	133
2.論文標題	5 . 発行年
Investigation of time variations of redox reactions in SrRuO3 through interface-sensitive	2023年
resistance measurements	
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Journal of Applied Physics	125306-1 - 10
掲載論文のD01(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1063/5.0135695	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	-

〔学会発表〕 計4件(うち招待講演 0件/うち国際学会 0件)

1.発表者名

神原 浩,田中弘行,大石 悟,天谷健一,辻井宏之

#### 2.発表標題

SrRu03-金属界面の室温水素雰囲気下における界面電気抵抗変化

### 3.学会等名

日本物理学会2020年秋季大会

4.発表年 2020年

1.発表者名

田中弘行,神原浩,天谷健一,辻井宏之

#### 2.発表標題

水素吸着によるSrRu03の電気伝導特性変化

3 . 学会等名

日本物理学会2019年秋季大会(岐阜大学柳戸キャンパス)

4.発表年 2019年

# 1.発表者名

田中弘行,神原浩,天谷健一,辻井宏之

### 2.発表標題

SrRu03-金属界面における水素吸着による電気抵抗変化

3.学会等名日本物理学会第75回年次大会

4 . 発表年

2020年

1 .発表者名 神原浩,嶋﨑大志,天谷健一

## 2 . 発表標題

SrRuO3-Ag界面の水素・一酸化炭素および酸素雰囲気下における界面抵抗の時間変化

3 . 学会等名

日本物理学会2022年秋季大会

4 . 発表年 2022年

## 〔図書〕 計0件

### 〔産業財産権〕

〔その他〕

-6 . 研究組織

0	・ H/T ノ しかユルBA		
	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
研究均	天谷 健一		
協力者	(Tenya Kenichi)		
	田中弘行		
研究協力者	(Tanaka Hiroyuki)		
	嶋﨑 大志		
研究協力者	(Shimazaki Hiroshi)		

6	. 研究組織 ( つづき )		
	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
研究協力者	大石 悟 (Oishi Satoru)		
研究協力者	过井 宏之 (Tsujii Hiroyuki)		

## 7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

## 8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関
---------	---------